

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : G11B 7/26, G01N 21/95, G02B 21/00		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/57413
		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:	28. September 2000 (28.09.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/02184		(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 13. März 2000 (13.03.00)		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i> <i>Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	
(30) Prioritätsdaten: 199 12 589.9 20. März 1999 (20.03.99) DE			
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): TUIOPTICS GMBH [DE/DE]; Fraunhoferstrasse 14, D-82152 Martinsried bei München (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MANSURIPUR, Masud [US/US]; 5748 N. Camino del Conde, Tucson, AZ 85717 (US). ERWIN, Kevin [US/US]; 2004 E. Ivington, Tucson, AZ 85714 (US). BLETSCHER, Warren, Jr. [US/US]; 6137 N. Pascola Circle, Tucson, AZ 85718 (US).			
(74) Anwalt: RÖSLER, Uwe; Landsberger Strasse 480 a, D-81241 München (DE).			

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR ANALYSING OPTICAL STORAGE MEDIA MATERIALS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MATERIALUNTERSUCHUNG OPTISCHER SPEICHERMEDIEN

(57) Abstract

The invention relates to a method and a device for analysing optical storage media materials, comprising a first, continuous laser beam which is directed at a surface of a storage medium, the beam that is reflected by the surface being used to analyse the surface reflectivity; and a second laser beam which effects a change in the reflective behaviour of the surface at least at the point where the first laser beam is reflected.

(57) Zusammenfassung

Beschrieben wird ein Verfahren zur Materialuntersuchung eines optischen Speichermediums mit einem ersten, auf eine Oberfläche des Speichermediums gerichteten kontinuierlichen Laserstrahl, dessen an der Oberfläche reflektierter Strahl zur Untersuchung der Oberflächenreflektivität verwendet wird und mit einem zweiten Laserstrahl, der wenigstens am Ort des Reflexionsereignisses des ersten Laserstrahls eine Veränderung des Reflexionsverhaltens der Oberfläche bewirkt.

